GIXRD技术原位实时测量晶体生长边界层微观结构的微型晶体生长炉

文献类型：专利

作者 殷绍唐； 张德明； 张庆礼； 孙敦陆； 张季； 王迪； 刘文鹏； 孙贵花

发表日期 2013
专利国别 中国
专利号 公开号 CN 203720111U
专利类型 实用新型
权利人 中国科学院
申请日期 2013
专利申请号 201320828702.X

源URL [http://ir.hfcas.ac.cn/handle/334002/21311]
专题 合肥物质科学研究院_中科院安徽光学精密机械研究所

作者单位 中国科学院合肥物质科学研究院 地址 230031 安徽省合肥市蜀山湖路 350 号

推荐引用方式 GB/T 7714
殷绍唐；张德明；张庆礼；孙敦陆；张季；王迪；刘文鹏；孙贵花. GIXRD技术原位实时测量晶体生长边界层微观结构的微型晶体生长炉, GIXRD技术原位实时测量晶体生长边界层微观结构的微型晶体生长炉, GIXRD技术原位实时测量晶体生长边界层微观结构的微型晶体生长炉, GIXRD技术原位实时测量晶体生长边界层微观结构的微型晶体生长炉, GIXRD技术原位实时测量晶体生长边界层微观结构的微型晶体生长炉, GIXRD技术原位实时测量晶体生长边界层微观结构的微型晶体生长炉, GIXRD技术原位实时测量晶体生长边界层微观结构的微型晶体生长炉, GIXRD技术原位实时测量晶体生长边界层微观结构的微型晶体生长炉, GIXRD技术原位实时测量晶体生长边界层微观结构的微型晶体生长炉, GIXRD技术原位实时测量晶体生长边界层微观结构的微型晶体生长炉, GIXRD技术原位实时测量晶体生长边界层微观结构的微型晶体生长炉, GIXRD技术原位实时测量晶体生长边界层微观结构的微型晶体生长炉, GIXRD技术原位实时测量晶体生长边界层微观结构的微型晶体生长炉. 公开号 CN 203720111U. 2013-01-01.

入库方式： OAI收割
来源：合肥物质科学研究院

浏览 0 下载 0 收藏 0

其他版本

除非特别说明，本系统中所有内容都受版权保护，并保留所有权利。

版权所有 @2023 中国科学院 - 运行维护： 中国科学院兰州文献情报中心/中国科学院西北生态环境资源研究院 - Powered by CSpace
0931-8270076 发送邮件
陇ICP备2021001824号-8 甘公网安备 62010202001088号